X線分析の進歩 第 42 集(2011)抜刷 Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan, 42 (2011)

アグネ技術センター ISSN 0911-7806

SDD を搭載したポータブル全反射蛍光 X 線装置による 感度及び定量性の改善

永井宏樹, 中嶋佳秀, 国村伸祐, 河合 潤

Improvement in Sensitivity and Quantification by Using a Portable Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometer Equipped with a Silicon Drift Detector

Hiroki NAGAI, Yoshihide NAKAJIMA, Shinsuke KUNIMURA and Jun KAWAI



SDD を搭載したポータブル全反射蛍光 X 線装置による 感度及び定量性の改善

永井宏樹,中嶋佳秀,国村伸祐*,河合 潤**

Improvement in Sensitivity and Quantification by Using a Portable Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometer Equipped with a Silicon Drift Detector

Hiroki NAGAI, Yoshihide NAKAJIMA, Shinsuke KUNIMURA^{*} and Jun KAWAI^{**}

Ourstex Co., LTD 13-20, Hommachi, Neyagawa, Osaka 572-0832, Japan * Materials Fabrication Laboratory, RIKEN 2-1, Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan ** Department of Materials Science and Engineering, Kyoto University Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan

(Received 12 November 2010, Revised 9 December 2010, Accepted 13 December 2010)

We have adapted a silicon drift detector (SDD) to a portable total reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectrometer using polychromatic X-rays from an X-ray source of singledigit watt. Analytical performance was greatly improved in PB ratio and the sensitivity for lighter elements when compared with the former spectrometer equipped with a Si-PIN detector.

In this article improved sensitivity of the new spectrometer is described, and additionally the evaluation of the current wave-guide, a newly developed sample preparation device for precise quantitative evaluation and an application to the analysis of suspended particles are reported. [Key words] Portable, Total reflection X-ray fluorescence spectrometer, SDD, X-ray waveguide, Low power X-ray tube, Polychromatic X-rays, Sample preparation support device

数ワットの小型X線管から発生する非単色X線を利用したポータブル全反射蛍光X線装置にSDDを採用し, 高感度化を行った.従来,ポータブル全反射蛍光X線装置の検出器にはSi-PIN検出器を使用していたが,SDD を搭載する事で,PB比の向上,軽元素の分析感度の向上を図ることが出来た.本報告では,SDDによる感度比 較,X線導波路の評価,点滴サポート冶具を用いた定量性の改善,応用事例について報告する. [キーワード] ポータブル,全反射蛍光X線装置,SDD,X線導波路,小型X線管,非単色X線,点滴サポー ト冶具

アワーズテック株式会社 大阪府寝屋川市本町13-20 〒572-0832

^{*}独立行政法人理化学研究所基幹研究所大森素形材工学研究室 埼玉県和光市広沢2-1 〒351-0198

^{**}京都大学大学院工学研究科材料工学専攻 京都市左京区吉田本町 〒606-8501

1. はじめに

全反射蛍光X線分析法1)は,試料表面におけ る微量分析が可能な事から一般的に良く知られ た分析法である.従来,全反射蛍光X線分析法 は,高出力のX線源を用い,試料への入射X線 をモノクロメータによって単色化し,スペクト ルのバックグラウンドを減少させる事によって 検出感度を向上させる事が通説とされてきた2). 一方,国村らは,従来の定説に反して低出力の X線管(数ワット)を用いて入射 X線に非単色 X線を用いる事で,単色化させた場合よりも検 出下限を改善できる事を明らかにした³⁻⁵⁾.筆者 らは、これらの研究成果を用いてポータブル全 反射蛍光X線装置の製品開発を行ってきた.開 発当初,検出器には Si-PIN 検出器 (X-123, Amptek Inc.)を用いて測定を行っていたが,エ ネルギー分解能の問題から微小ピークの分析や, 軽元素領域の分析感度が不十分であった.本報 告では、ポータブル全反射蛍光X線分析装置に、 SDD(Silicon Drift Detector)を採用し搭載した. SDD を搭載する事によって PB 比を大幅に向上 させる事ができ, Si-PIN 検出器では検出できな かった微少ピークの分析や 軽元素領域のPにつ いても高感度分析が可能となった 本報告では, SDDを搭載したポータブル全反射蛍光X線装置 の概要を述べ,Si-PIN検出器とSDDとの比較評 価,溶液サンプル専用点滴サポート補助冶具を 用いた試料調整及び定量評価について述べ、最 後にポータブル全反射蛍光X線装置を用いた応 用事例について紹介する.

2. ポータブル全反射蛍光 X 線装置

Fig.1に開発したポータブル全反射蛍光X線装 置[OURSTEX200TX]の写真を示す.装置はコ



Fig.1 Photograph of portable TXRF spectrometer. [OURSTEX200TX]

ンパクトで総重量は8 kg となっている. 電源は AC100 Vで使用でき可搬性に優れた装置となっ ている.Fig.2にポータブル全反射蛍光X線装置 の構造写真を示す.X線管には最大電圧,管電流 がそれぞれ 50 kV, 200 µA の透過式小型 X 線管 を用いた.X線管ターゲットにはタングステン を用いている、検出器には電子冷却式のSDD(受 光面積7 mm², Be厚さ8 µm)を用いた.SDDの 構造はSi-PIN に FET が一体化され,表面上にリ ング状の電極勾配が作られた構造になっており, 効率よく電子を中心部のアノードにドリフトさ せる事ができる.このため,サーマルノイズの 減少,電荷集荷効果の向上,モレ電流の減少な どが計れるため,エネルギー分解能が向上し, PB比が大きくなり,高計数率での測定にも分解 能を落とさず測定できる.また,一般的にSi-PIN 検出器の場合,受光面積を大きくすると分解能 が低下するが,SDDではエネルギー分解能の低 下が殆ど無い事も利点の一つである.一方 SDD 検出器では,結晶厚みが450 µm と薄いため,高 エネルギーのX線は素子を透過しやすく高エネ ルギー領域での検出効率はあまり高くないと いったデメリットもある、また、X線管から照射



Fig.2 Photograph of portable TXRF system.



Fig.3 (a) Schematic drawing of the wave-guide device.(b) Photograph of the wave-guide device.

された入射X線を平行化するためにX線導波路 を用いた.X線導波路は,X線管から発生したX 線を, Fig.3(a)で示すように2枚のシリコンウエ ハを用いて入射X線の平行化を行なう光学素子 である.鏡面のシリコンウエハを用いる事で入 射 X 線の一部が全反射されるため,通常のス リットを用いるよりも強いX線が得られる.シ リコンウエハの間隔は,横幅を10mmに,縦幅 を10 µmに設計し製作した3).X線導波路の概観 写真を Fig.3(b)に示す.製作した X 線導波路は, 機械加工の精度やシリコンウエハをカットした 際のエッジによる影響などによってスリット幅 が変動する恐れがあるため,X線導波路の出口 にステンレス製のカッターの刃を設置し,ナイ フエッジスキャン法にてX線導波路のスリット 幅の評価を行った 得られたデータを微分し ガ ウスフィッティングによって半値幅を求めてス リット幅を評価した.その結果を Fig.4 に示す. その結果、スリット幅は16.5 µmとなり、設計時



Fig.4 A profile of the measured edge-scan, and the evaluated beam profile of the wave-guide device.

に想定した 10 μm と近い値となった. 試料台に は石英オプティカルフラットを用いた(反射波 面精度:λ/20・シグマ光機製)また,試料台下 に設置されているゴニオメーターによって遷移 金属に対して最適な入射角度0.05°辺りに調整し ている⁶⁾.

3. 結果と考察

3.1 SDD 採用による PB 比の改善

本装置では,検出器にSDDを用いた.本装置 に用いたSDDのエネルギー分解能は,Mn-Kα線 の半値幅(FWHM)において132 eVである(従 来使用していた Si-PIN 検出器の分解能は,Mn-Kα線のFWHMにおいて180 eVである)Fig.5に Si-PIN 検出器とSDDのスペクトルの比較を示 す.スペクトルは励起源であるW-Lα線のピーク 強度で規格化した.測定試料はSc,Cr,Co,As, Srがそれぞれ0.5ppmの水溶液をオプティカル フラット上に2 m/滴下し乾燥させた物を用いた (1 ng).測定の結果,Si-PIN検出器に比べてSDD では,エネルギー分解能が向上しPB比について も向上した.それぞれのPB比についてFig.6 に 示した.Coでは,Si-PIN検出器のPB比が0.921 でSDDのPB比が1.796となり約2倍向上した. また,SDDにより分解能が向上した事で,Si-PIN 検出器では分離できなかったAr-Kα線とAr-Kβ 線のピークを分離でき,その他の微少ピークに ついても検出する事ができた.また,得られた スペクトルから見積もったSc,Cr,Co,As,Srの 検出下限値は,1800秒測定においてそれぞれ,29 pg,20 pg,14 pg,51 pg,192 pgとなった.なお, 検出下限値LLDの算出には以下の理論計算式を 用いた⁷⁾.

$$LLD = 3 \times \frac{W}{I_{\rm NET}} \times \sqrt{\frac{I_{\rm BG}}{t}}$$
(1)

ここで,W:含有量(ng),t:測定時間(sec),
*I*_{NET}: ピークのNet強度(cps),*I*_{BG}:バックグラ
ウンド強度(cps)である.



Fig.5 Total reflection X-ray fluorescence spectra of a dried droplet containing 1ng of Sc, Cr, Co, As, and Sr. The data acquisition time was 1800 s, and the detector used were a) Si-PIN and b) SDD. ; Peak from collimator material of SDD.



Fig.6 A comparison of PB ratios for various element obtained with the Si-PIN detector and with the SDD detector.

今回得られた Co の検出下限値は,国村らに よって以前報告された値⁶⁾と同じ値となった が,理由として,今回使用した SDD の受光面積 は7 mm²であるため,Si-PIN 検出器の13 mm²に 比べてX線強度が低くなったためだと考えられ る.今後,試料の点滴痕サイズにもよるが,大 口径のSDDを使用する事で大幅な検出感度の向 上が見込めると考えている.

3.2 点滴サポート冶具を用いた定量性の改善 全反射蛍光X線分析において,定量評価を行 う上で試料調整は大変重要な要素を占める.本 装置の場合,オプティカルフラット上に試料溶 液を滴下させ,乾燥残差を測定する.この場合, 試料溶液をオプティカルフラットの中心部に滴 下しないと、検出器の取り込み角度の関係から,





Fig.7 (a) Schematic drawing of the sample preparation support device. (b) Photograph of the sample preparation support device.

X線強度の変化が顕著に現れ,これが定量精度 を低下させる要因となってしまう.そこで, Fig.7のような点滴サポート冶具を作成した.こ の冶具は,上部にマイクロピペットチップの先 端が挿入できるように細い穴を開けており,常 に一定の深さまで差し込める形状になっている. これを用いる事で常にオプティカルフラットの 中心部に溶液を滴下させる事ができるようにな り,定量精度が向上させることができる.また, この冶具の材質には,コンタミネーションの影 響も考え,アクリルで作成し,使用後は洗浄す る事で再利用できる. 点滴サポート冶具の効果 を調べるために、Crの標準溶液を10ppmに調整 し, 点滴サポート冶具を用いて5ml滴下させた 場合と点滴サポート冶具を使用せずに滴下させ た場合でCr-Kα線のX線強度の変化を調べた 測 定結果をTable 1 に示す.その結果, 点滴サポー ト冶具を用い無い場合と比べ,X線強度の変化 を小さく抑える事ができた.

本装置の定量性を評価するために,Coおよび Crについて検量線作成を行った.Fig.8に実験よ り得られた検量線を示す.試料は、CrおよびCo

Table 1Improvement in reproducibility with and with-
out the sample preparation support device.

N	With sample support device		Without sample support device	
	Cr (counts)	Cr/Sc	Cr (counts)	Cr/Sc
1	2669	1.69	3524	1.73
2	3220	1.66	2664	1.65
3	2771	1.64	2563	1.71
4	3200	1.67	3762	1.66
5	3336	1.69	1460	1.68
Average	3039.2	1.67	2794.6	1.69
Standard deviation	266.7	0.02	814.8	0.03
CV(%)	8.8	1.1	29.2	1.7



Fig.8 Calibration curve of chromium and cobalt.

の原子吸光用標準溶液を希釈して,それぞれ, 500ppb,100ppb,50ppb,25ppb,10ppbの濃度にな るように調整した.また,内標準としてSc溶液 を一定量添加し,溶液をオプティカルフラット 上に10µ/滴下乾燥させて測定試料とした,測定 の結果,CrおよびCo共に良い直線性が得られ, 低濃度領域においても充分な定量性がある事が 確認できた.

3.3 軽元素に対する感度の改善

本装置の軽元素領域での分析感度を確認する ため,溶液中のP分析を行った.従来用いていた Si-PIN検出器ではエネルギー分解能の問題から, P-Kα線のピークが,オプティカルフラットに起 因するSi-Kα線のピークの裾部分に埋もれてし まい,微量のP分析は困難であった.そこでSDD を搭載した本装置にて微量のP分析が行えるか



Fig.9 Total reflection X-ray fluorescence spectra of phosphorus.

実験を行った.試料は,Pの標準溶液をそれぞ れ,1ppm,0.5ppm,0.1ppmになるように希釈し, オプティカルフラット上に5ml 滴下乾燥させ, 測定試料とした.試料の絶対量としては,それ ぞれ 5 ng, 2.5 ng, 0.5 ng である. Pの測定スペク トルをFig.9に示す.測定の結果より0.5 ngにお いても充分検出できている事が確認できた.ま た,0.5 ngのピーク強度とバックグラウンド強 度から式(1)を用いて見積もった検出下限値 は,1800秒測定において286 pgとなり,大気雰 囲気測定において、軽元素領域でも高感度で分 析ができることが確認できた.これは,SDD検 出器によってエネルギー分解能が向上した事 と,全反射蛍光X線の構造上,試料と検出器の 距離が極端に短く,検出器が試料の上部にあ り,通常の蛍光X線装置で用いる試料保持用の 高分子フイルム等による吸収を受けないためだ と考えられる.

3.4 応用例

ポータブル型全反射蛍光X線装置を用いた応 用事例として,土壌浸出水8)やお茶,玩具から の浸出水9)など数多く報告されているが,本報 告では,大気浮遊粒子の元素分析の可能性につ いて検討した.測定は,オプティカルフラット をシャーレに載せ,サンプリング場所に1時間 放置し,オプティカルフラット上に堆積した粒 子を直接測定した.試料の採取場所は,大阪府 寝屋川市の国道沿いで比較的交通量の多い場所 である.測定結果スペクトルをFig.10に示す.ブ ランクと比べて, Al, S, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Zn などが検出された.今回,試料採取を交通量の 多い場所で行ったため, 排気ガスやブレーキ パッドの磨耗金属などが検出されたのでは無い かと推測される、今後,試料の採取方法の問題 など課題はあるが,大気浮遊粒子の環境モニタ リングなどに応用できるのでは無いかと考えて いる.



Fig.10 Total reflection X-ray fluorescence spectra of suspended particulate matter. (Collection place of sample; Neyagawa Osaka, Japan)

4. おわりに

本研究では,数ワットの小型X線管から発生 する非単色X線を利用したポータブル全反射蛍 光X線装置の検出器にSDDを搭載する事で,エ ネルギー分解能を向上させ,従来のSi-PIN検出 器と比べて約2倍程度PB比を向上させる事がで きた.さらに,軽元素領域であるPの分析感度が 向上し,Pの検出下限値としては,286 pgが得ら れた.また,今回作製した試料調整用の点滴サ ポート冶具により安定した試料調整が行え,定 量精度を改善させる事ができた.本装置は,小 型軽量であるため,大気浮遊粒子や南極など,サ ンプルの保管や持ち出しが困難な場合の分析や, 装置を直接酪農家に持ち込んで家畜の毛髪を測

定し,家畜の健康状態などを把握するなどの応 用ができるのでは無いかと考えている.

参考文献

- 1) Y.Yoneda, T.Horiuchi: *Rev. Sci. Instrum.*, **42**, 1069 (1971).
- 2) A.Iida, Y.Gohshi: Jpn. J. Appl. Phys., 23, 1543 (1984).
- 3) S.Kunimura, J.Kawai: Anal. Chem., 79, 2593 (2007).
- 4) 国村伸祐,河合 潤:化学と工業,61,1050 (2008).
- 5) 国村伸祐,河合 潤:分析化学,58,1041 (2009).
- 6) 国村伸祐,河合 潤:X線分析の進歩 A1, 29 (2010).
- 7) 中井泉編:「蛍光X線分析の実際」(2005),(朝 倉書店).
- 8) 国村伸祐,河合潤,丸茂克美:X線分析の進歩,38,367 (2007).
- 9) 国村伸祐,渡辺大輔,河合潤:分析化学,57, 135 (2008).